

奥普斯 SY-DT07 等离子处理设备技术规格

一、设备图如下



二、简介

小型化等离子设备适合实验室使用，进行单次小批量作业。

三、产品特点

1. 高可靠性、高重复性。
2. 宽泛的参数调节范围，可使用多种气体，实现最大范围的参数选择。
3. 手自一体控制模式，方便操作。
4. PLC 控制功率、质量流量控制等实现参数的精确控制和记录。
5. 适合各种材质，例如高分子材料、陶瓷、金属等的表面处理。
6. 设备体积小，适合空间紧张的实验室使用。

四、技术参数

NO	项目	规格
1	设备尺寸	530*538*674 (mm)
2	重量	75Kg
3	电力需求	220VAC, 50Hz
4	腔体尺寸	210*210*220 (mm) 铝合金
5	载物层数及面积	2 层 150*174*60 (W*D*H)
6	真空泵形式	机械泵
7	等离子发生源	40kHz, 1500W 或 13.56MHz, 100W
8	处理时间	0-15 分钟
9	可使用气体	Ar、N2、O2、H2、CO2、空气等
10	控制系统	PLC+触摸屏
11	流量控制	一路质量流量计

五、外形尺寸图

